

《論 文》

화화증착법에 의한 알루미나이드 코팅층의 형성

손희식* · 홍석호 · 김문일

연세대학교 공과대학 금속공학과

*국방과학연구소

Aluminide Coatings on IN713C by Chemical Vapor Deposition

H. S. Sohn*, S. H. Hong and M. I. Kim

Dept. of Metallurgical Engineering, Yonsei University

*Agency for Defence Development

ABSTRACT

The purpose of this study is to clarify the influence of the reaction temperature and AlCl_3 content on the aluminide coating formation on Ni-based superalloy IN713C in CVD process and to compare its throwing power with that of Pack Cementation process.

Aluminide coating was formed by CVD in hot-wall stainless tube reactor from an $\text{AlCl}_3\text{-H}_2$ mixture in the temperature range 850~1050°C.

At reaction temperature 850°C, the coating thickness and the content of aluminium at the surface were increased as AlCl_3 heating temperature was raised. At reaction temperature 1050°C, they were not influenced by the variation of AlCl_3 heating temperature. When AlCl_3 heating temperature was fixed 125°C, the phases of the coatings were varied from Ni_2Al_3 to Al-rich NiAl and to Ni-rich NiAl with the reaction temperature. Therefore, in this study the reaction temperature has been found to be a major factor in determining the phase formed in CVD process. The throwing power of CVD was superior to that of Pack Cementation.

1. 서 론

초내열합금의 내식성을 향상시키기 위하여 처음으로 널리 사용된 확산코팅은 합금표면에 보호성 산화막을 형성하는 원소(Al, Cr, Si)를 첨가시키는 코팅이다. Cr이나 Si을 확산시킨 코팅의 경우, 950°C 이상의 온

도에서 산화막이 분해, 휘발되므로, 사용온도가 1100 °C에 달하는 티빈 블레이드와 같은 부품은 주로 Al을 확산시킨 알루미나이드 코팅이 사용된다.^{1)~3)}

알루미나이드 코팅은 Hto-dipping, Slurry, Pack Cementation, CVD등과 같은 다양한 방법으로 처리되어 왔으며, 그중 팩세멘테이션 공정이 가장 널리 사용

되어 왔다. 이것은 제조공정이 간단하고 비용이 저렴하다는 장점이 있다. 그러나 모재표면이 팩 분말과 접촉함으로서 팩 입자들로 인한 오염의 위험성과 작은 구멍이 있는 복잡한 형상에는 코팅층이 형성되지 않는다는 문제점들이 있다.

화학증착법은 코팅될 모재가 분말과 접촉하지 않는다는 점을 제외하고는 팩세멘테이션 공정과 같은 기본 반응을 이용한다. 화학증착법에서는 반응종들(AlCl_3 , AlCl_2 , AlCl)이 반응기 내에서 발생하여 모재에 흡착한 후 확산하여 코팅층을 형성한다. 이 기상증착과정은 팩세멘테이션 공정과 달리 코팅두께와 형상이 팩 분말과 표면적의 비에 의존하지 않으므로 복잡한 내부 구조를 갖는 재료에도 균일한 코팅층을 형성시킴으로써 코팅두께와 미세구조를 쉽게 조절할 수 있다.^{4,5)}

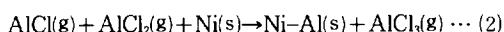
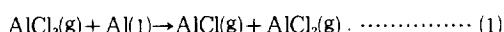
따라서 본 연구에서는 화학증착법에 의한 알루미나이드 코팅층의 형성시, 대표적인 공정변수인 반응온도와 AlCl_3 공급량을 변화시켜 Ni계 초내열합금인 IN713C에 알루미나이드 층을 형성시키고 각 변수가 알루미나이드 코팅층의 형성에 미치는 영향을 고찰하였으며, 최적 조건에서 화학증착법과 팩세멘테이션 공정의 균일증착성(Throwing Power)을 비교하였다.

2. 실험장치 및 실험방법

2. 1. 화학증착법

시편은 Ni계 초내열합금 IN713C를 직경 10mm, 두께 3mm의 disk형으로 절단하고 연마한 후 트리클로로에틸렌으로 초음파 탈지, 세척하여 준비하였다. 실험에 사용한 장치는 Fig. 1과 같다.

알루미나이드 코팅은 AlCl_3 의 안정성 때문에 수소환원반응에 의해서는 형성되기가 어렵다. 그러나, Al은 다음과 같은 반응식에 의해 빠른 속도로 증착될 수 있다.



따라서, 화학증착법에 의한 알루미나이드 코팅은 800~1,100°C의 온도에서 $\text{Al} + \text{Al}_2\text{O}_3$ 혼합분말 위로 $\text{AlCl}_3 + \text{H}_2$ 의 혼합가스를 통과시킴으로써 형성될 수 있으며,⁴⁾ 이때 주입되는 AlCl_3 증기의 양은 AlCl_3 용기를 가열하여 조절할 수 있다.

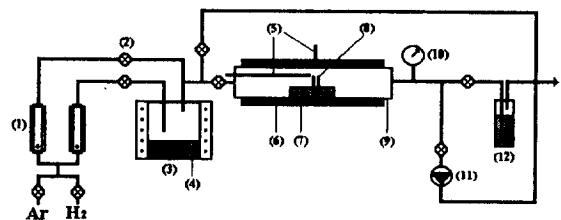


Fig. 1 Schematic diagram of the reaction apparatus.

- | | |
|---|--|
| (1) flow meter | (7) $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Al}$ powder |
| (2) valve | (8) specimen |
| (3) AlCl_3 bath and heating coil | (9) stainless tube |
| (4) AlCl_3 | (10) bordon gauge |
| (5) thermocouple | (11) rotary pump |
| (6) mulite tube and heating coil | (12) NaOH bubbler |

팩세멘테이션 공정에서 나타나는 내향성화산코팅 및 외향성화산코팅을 화학증착법에 의해 재현하기 위하여 반응온도를 850°C와 1,050°C로 선택하였으며, 그때 AlCl_3 의 양이 코팅층의 상에 미치는 영향을 분석하기 위해서 AlCl_3 가열온도를 각각 90°C, 107.5°C, 125°C로 변화시켰고 반응시간은 4시간으로, H_2 flow rate는 300sccm으로 일정하게 유지시켰다.

또한, 반응온도에 따른 코팅층의 미세구조 변화를 고찰하기 위하여 AlCl_3 가열온도 125°C에서 반응온도를 850°C, 900°C, 950°C, 1,000°C, 1,050°C로 변화시켜 실험하였다.

2. 2. 균일증착성

균일증착성을 비교하기 위하여 화학증착법의 경우, AlCl_3 가열온도 125°C에서 각각 반응온도와 시간을 850°C, 6시간과 1,050°C, 4시간으로 내향성 및 외향성화산코팅을 하였다. 팩세멘테이션 공정의 경우는 Ar분위기에서 내향성코팅은 850°C에서 15wt.% Al + 3wt.% NH_4Cl + 82wt.% Al_2O_3 조성의 200g 팩을 사용하여 2시간 코팅하였으며, 외향성코팅은 1,050°C에서 15wt.% Ni_2Al_3 + 3wt.% NH_4Cl + 82wt.% Al_2O_3 조성의 200g 팩을 사용하여 4시간 코팅하였다. 이때 두께 100, 50μm로 압연한 스테인레스 판을 15°C × 8mm × 2mm의 육면체형 시편 2개 사이에 위치시켜서 틈을 만들었어, 코팅 후 깊이에 따른 두께변화를 광학현미경으로 관찰하였다.

2. 3. 분석방법

화학증착된 알루미나이드 코팅층의 상을 분석하기 위해서 X선회절분석을 실시하였다. Cu-K α 선으로 관전압 40kV, 관전류 30mA, 주사속도 4°/min의 일정 조건 하에서 수행하였다.

단면구조는 광학현미경과 주사전자현미경을 사용하여, 최종연마한 상태와 애칭(HCl : HNO₃ : CH₃COOH = 30 : 20 : 20의 애칭액)한 상태를 관찰하였으며, 코팅층의 성분분석은 EDS를 이용하면 단면과 표면을 분석하였다.

3. 실험결과 및 고찰

3. 1. AlCl₃가열온도의 영향

3. 1. 1. 상 및 성분분석

AlCl₃의 가열온도를 90, 107.5, 125°C로 각각 변화시켰을 때, 반응온도 850°C에서 AlCl₃의 가열온도가 90°C와 107.5°C인 경우를 X선회절분석한 결과, 표면에 코팅층을 확인할 수 없었으나 125°C에서는 Ni₂Al₃상이 관찰되었다. 반응온도 1,050°C의 경우는 가열온도에 관계없이 NiAl 상만이 나타나, AlCl₃가열온도의 변화가 코팅층의 형성상에는 영향을 주지 못하는 것으로 나타났다.

반응온도 850°C와 1,050°C에서 AlCl₃가열온도에 따른 표면조성의 변화를 Fig. 2에 나타내었다. 반응온도 850°C인 경우, AlCl₃가열온도 90°C에서는 표면조성이 거의 모재(IN713C)의 조성과 비슷하였으며, AlCl₃가열온도가 증가함에 따라 Al의 분율이 증가하여 AlCl₃가열온도 125°C에서는 화학정량적 Ni₂Al₃ 조성보다 Al의 양이 약간 높게 나타났다. 1,050°C의 경우는 AlCl₃가열온도의 변화와 관계없이 코팅층의 표면조성이 NiAl로 나타났다. 이러한 표면조성의 결과는 상술한 XRD 결과와 일치함을 알 수 있다.

3. 1. 2. 단면미세구조의 변화

반응온도 1,050°C와 850°C에서, AlCl₃가열온도의 변화에 따른 단면구조의 변화를 Photo. 1에 나타내었다. 앞 절의 XRD 및 표면조성분석에서 예측된 바와 같이 1,050°C의 경우 AlCl₃가열온도에 관계없이 모두 전형적인 NiAl 외향성화산코팅 단면구조를 나타내고

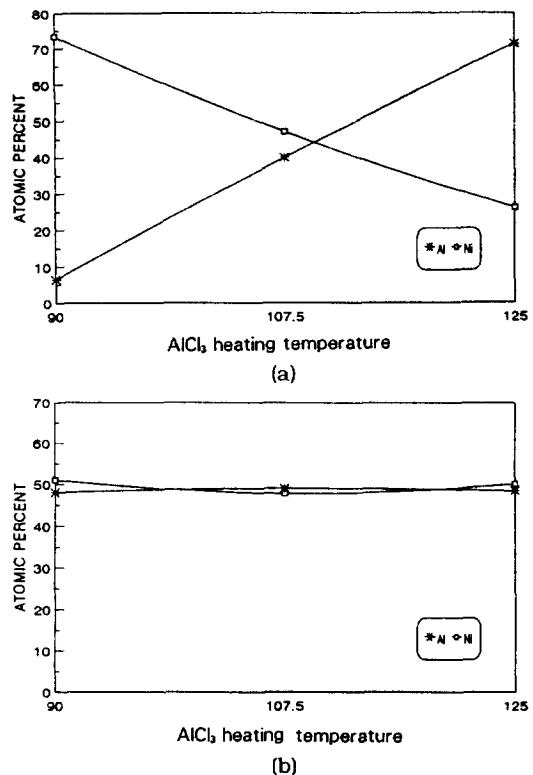


Fig. 2 Variation in surface composition(Ni and Al) of aluminide coatings with AlCl₃ heating temperature and reaction temperature.

- (a) reaction temperature 850°C
- (b) reaction temperature 1,050°C

있으며, AlCl₃가열온도가 증가함에 따라 코팅층의 두께는 약간 증가하고 있다.

850°C에서는 AlCl₃가열온도 90°C의 경우, 코팅층이 표면에 거의 형성되지 않았으며, AlCl₃가열온도가 증가함에 따라 코팅층의 두께가 증가하여 125°C에서 전형적인 내향성화산코팅 구조가 형성됨을 알 수 있다.

따라서 화학증착법에 의한 알루미나이드 코팅층의 형성시 본 실험범위 내에서 페세멘테이션 공정과 같은 내향성화산코팅 및 외향성화산코팅을 재현할 수 있음을 확인할 수 있다.

위에서 나타난 현상들을 보다 자세히 고찰하기 위하여 평형상태에서 각 기체 반응종들의 양을 계산하여 그에 따른 결과를 비교하여 보았다. 평형분압을 계산하기 위해서 Solgas-mix 프로그램⁶⁾을 사용하였다.

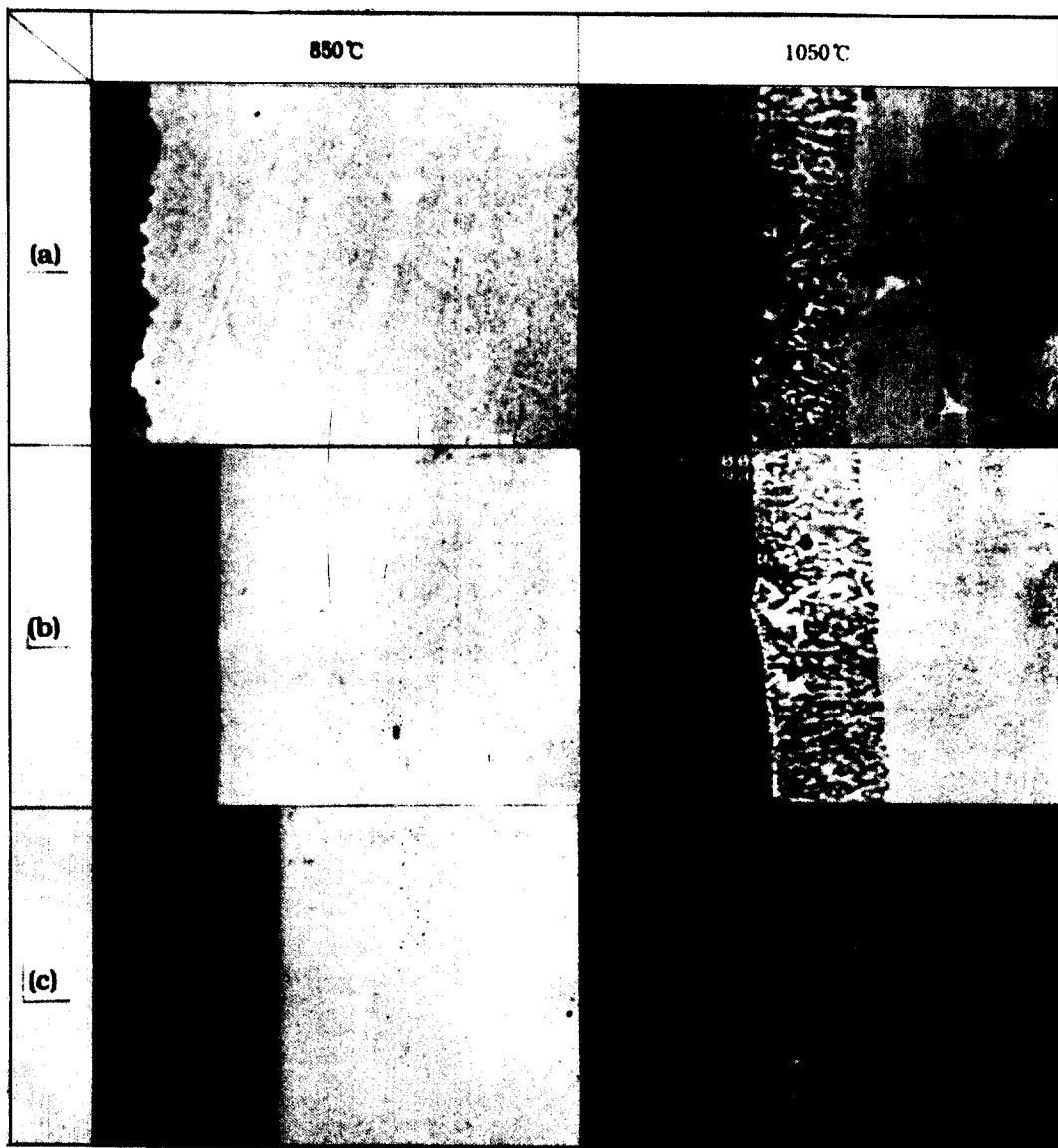


Photo. 1 SEM cross-sectional micrographs of specimens coated at reaction temperature 850°C and 1,050°C.

- (a) AlCl_3 heating temperature 90°C
- (b) AlCl_3 heating temperature 107.5°C
- (c) AlCl_3 heating temperature 125°C

Table. 1은 2.2절의 실험조건에 따라 폐세멘테이션 공정에 의하여 내향성화산코팅 및 외향성화산코팅을 형성할 때 계산된 기체반응종들의 평형분압을 나타낸다. 계산에 사용된 열역학 자료는 I. Barin⁷⁾의 자료를 참고하였으며, 전체압력 1기압, 팩질량 200 g과 부피

는 직경 10cm, 길이 25cm의 노중앙 부위로 가정한 단한 계에 대하여 계산하였다. 결과 중 평형분압이 10^{-10} atm이하의 가스종들은 제외 시켰다. Table. 1에 따르면, Al기체반응종들 중 AlCl_3 를 제외하고는 내향성화산코팅 조건이 외향성 화산코팅 조건보다 평형분압이

Table 1. Thermodynamic calculations of the equilibrium composition of a pack by SOLGAX-MIX under argon : $P_{\text{total}} = 1 \text{ atm}$

Type Condition	Outward Type	Inward Type
Temperature(°C)	1050	850
Species	Pressure(atm)	Pressure(atm)
AlCl	.92423E-03	.13719E-01
AlCl ₂	.27220E-02	.50745E-02
AlCl ₃	.13229E+00	.99767E-01
AlCl ₆	.59220E-04	.21241E-03
Cl	.15784E-07	
Al	.32529E-09	.31188E-08
H ₂	.82351E+00	.64909E+00
Ar	.29624E-01	.23199E+00
HCl	.10865E-01	.13971E-03
AlH	.74753E-09	.20155E-07
H	.14267E-05	.34374E-07
NH ₃	.17838E-07	
N ₂	.42840E-07	
Ni	.57264E-09	
NiCl	.18076E-07	
NiCl ₂	.13283E-06	

높으며, 주요 기체반응종인 AlCl의 평형분압은 내향성화산코팅이 약 0.0137atm, 외향성화산코팅은 약 0.0009atm으로 내향성화산코팅의 경우가 약 15배정도 평형분압이 더 높게 나타났다.

Fig. 3은 화학증착법에 의하여 코팅을 하였을때, 반응온도 850°C와 1,050°C에서 AlCl₃가열온도의 변화에 대한 각 기체반응종들의 평형분압 계산결과를 나타낸다. 이때, AlCl₃와 H₂의 입력 mole은 AlCl₃포화증기압의 값을 이용하였으며, 계산된 값들 중 Al 기체반응종들만 표시하였다.

Fig. 3에서 내향성화산코팅이 형성된 온도인 850°C의 경우를 살펴보면, AlCl₃가열온도가 90°C일때 AlCl의 평형분압이 약 0.0012atm로써 퀘세멘테이션 공정(Table. 1 참조)보다 약 11배정도 적은 값이며, 다른 Al기체반응종들도 훨씬 더 낮은 값을 갖고 있다. 따라서, AlCl₃가열온도 90°C에서 코팅층이 형성되지 않은 이유는 기체반응종들의 양이 부족하기 때문인 것

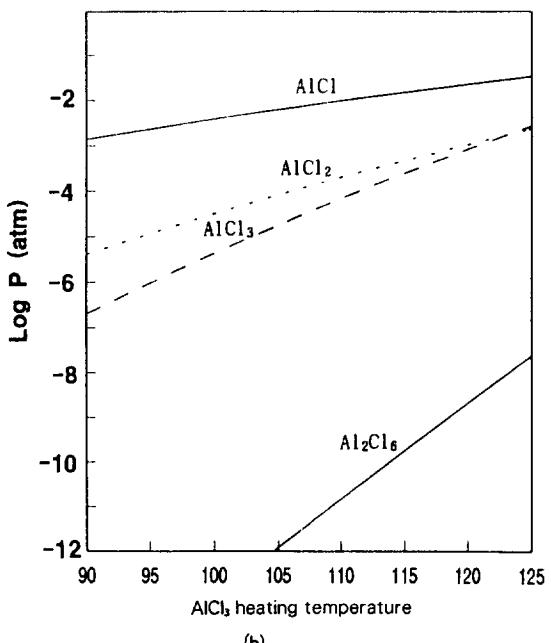
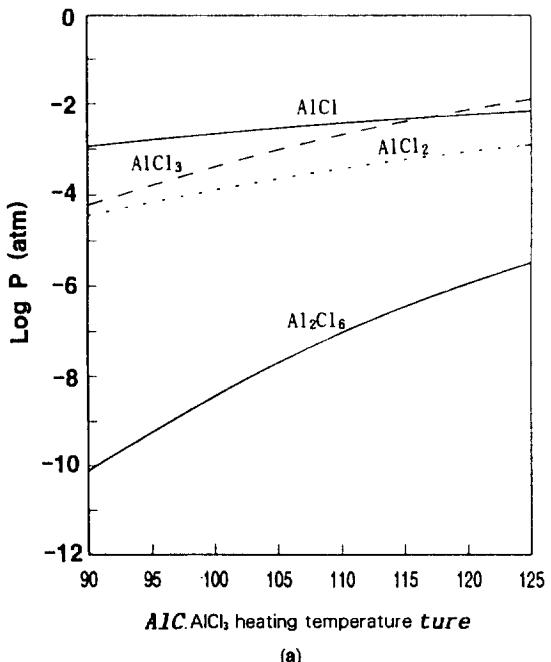


Fig. 3 Variation in calculated equilibrium partial pressure of gaseous species with AlCl₃ heating temperature : $P_{\text{total}} = 1 \text{ atm}$, H₂ atmosphere.

(a) reaction temperature 850°C

(b) reaction temperature 1,050°C

으로 생각된다.

또한, Fig. 3a로부터 AlCl_3 가열온도의 변화에 대한 AlCl_1 및 AlCl_2 의 평형분압의 변화가 코팅층의 표면조성(Fig. 2b) 및 두께 변화(Photo. 1)에 큰 영향을 미치는 것을 알 수 있다. 따라서 내향성화산코팅의 경우는 주요 기체반응종 즉, AlCl_1 의 양이 코팅층의 형성 속도와 상 결정에 지배적인 인자라고 생각된다.

외향성화산코팅이 형성된 온도인 $1,050^\circ\text{C}$ 의 경우를 살펴보면, AlCl_1 의 평형분압은 팩세멘테이션 공정에서는 0.0009atm 이고, 화학증착법(Fig. 3b)에서는 AlCl_3 의 가열온도가 90°C , 107.5°C , 125°C 일때, 각각 0.0014atm , 0.0079atm , 및 0.0333atm 으로 팩세멘테이션 공정에서의 계산결과보다 모두 더 높은 평형분압이 발생하였으나, 다른 Al 기체반응종들은 더 낮은 평형분압을 나타내었다. 계산된 평형분압의 차이에도 불구하고 외향성화산코팅이 AlCl_3 가열온도의 변화에 따라 상이 변화하지 않고(Fig. 2b), 두께차이가 크게 나타나지 않은(photo. 1) 이유는 팩세멘테이션 공정에서의 연구결과⁸⁾와 마찬가지로 고체상태의 확산이 반응을 지배하기 때문인 것으로 생각된다.

3. 2. 반응온도의 영향

앞 절의 실험결과에 의하면 AlCl_3 의 가열온도 125°C 에서 내향성 및 외향성화산코팅이 반응온도 850°C 와 $1,050^\circ\text{C}$ 에서 각각 형성되었다. 이로부터 적절한 AlCl_3 가열온도에서는 반응온도가 코팅층의 상 결정에 지배적인 인자로 작용할 것으로 판단할 수 있다. 따라서 반응온도가 코팅층의 상 결정에 미치는 영향을 고찰하기 위하여, AlCl_3 가열온도를 125°C 로 고정하고, 반응온도를 변화시켜 그에 따른 영향을 분석 고찰하였다.

3. 2. 1. 상 및 성분분석

AlCl_3 가열온도 125°C 에서 반응온도에 따른 XRD 분석결과를 Fig. 4에 나타내었다. 반응온도 $850, 900^\circ\text{C}$ 의 경우 Ni_2Al_3 상이 관찰되었고, 반응온도 $950, 1,000, 1,050^\circ\text{C}$ 의 경우는 모두 NiAl 상이 관찰되었다. 이로부터 AlCl_3 가열온도 125°C 에서 코팅층의 상 결정은 주로 반응온도에 의해 결정되는 것을 알 수 있다.

Fig. 5은 AlCl_3 가열온도 125°C 에서 반응온도에 따른 코팅층의 표면조성 변화를 나타낸 것이다. XRD 결

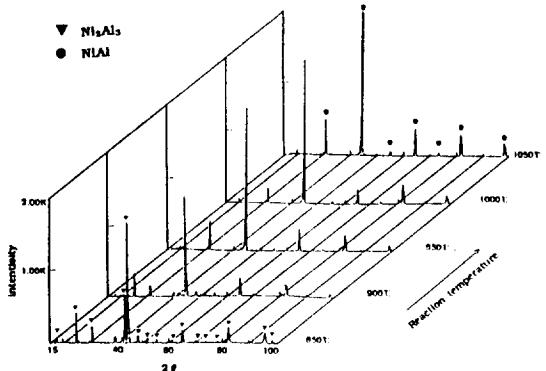


Fig. 4 Effect of reaction temperature on the X-ray diffraction patterns of specimens coated at AlCl_3 heating temperature 125°C .

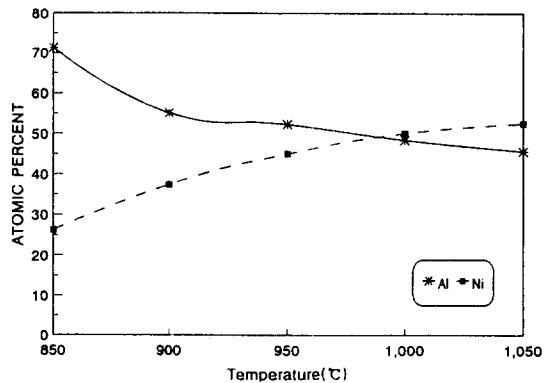


Fig. 5 Variation in surface composition(Ni and Al) of aluminide coatings with reaction temperature : AlCl_3 heating temperature 125°C .

과와 마찬가지로 반응온도 $850, 900^\circ\text{C}$ 의 경우 Ni_2Al_3 의 조성이 나타나고, 반응온도 $950^\circ\text{C}, 1,000, 1,050^\circ\text{C}$ 의 경우에는 NiAl 의 조성이 나타났다. 반응온도 950°C 의 경우, 표면조성이 Al-rich NiAl 에 해당되며, 이러한 Al-rich NiAl 상에서는 Ni보다 Al의 확산이 우세하므로 Al의 내향성 확산이 주로 일어났음을 추측 할 수 있다.

3. 2. 2. 단면미세구조의 변화

반응온도에 따른 단면구조의 변화를 Photo. 2에 나타내었으며, 이로부터 코팅층의 두께는 반응온도의 증가와 함께 증가하고 있음을 알 수 있다.

반응온도 850°C 와 900°C 의 코팅층을 예칭한 사진

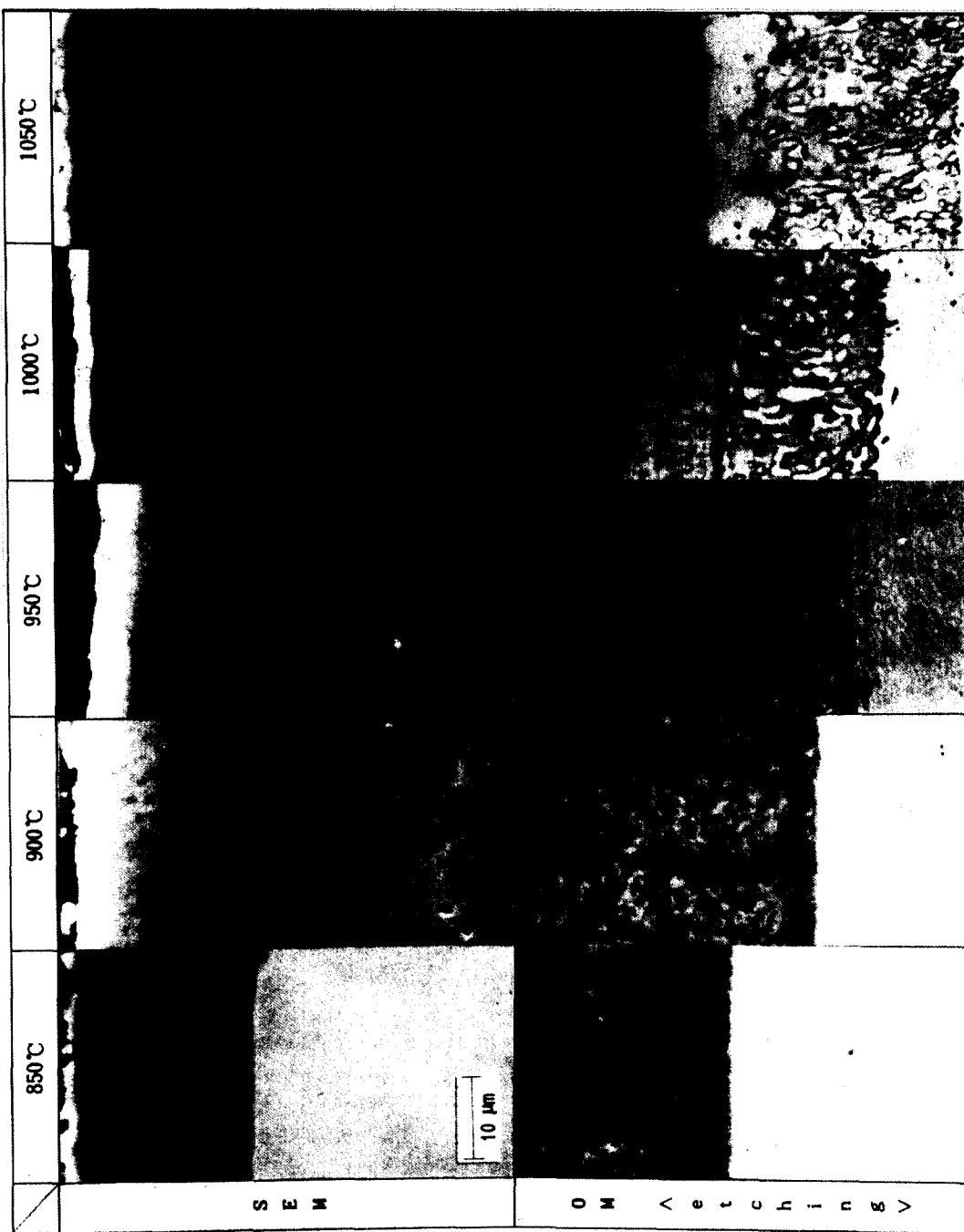


Photo. 2 SEM and OM cross-sectional micrographs of spicimens coated at different reaction temperatures : AlCl_3 heating temperature 125°C.

을 보면 코팅층 내부에 미세한 석출물들을 관찰할 수 있으며, 이러한 조직은 Goward와 Boone⁹⁾이 팩세멘테이션 공정에서 보고한 바와 잘 일치하고 있다. 그들의 보고에 의하면 내향성화산코팅의 형성층은 Ni_2Al_3 , 기지에 모재합금원소인 Cr과 Mo가 미세하게 석출하고 있으며, 또한 MC와 M_2C_6 형태의 모재 탄화물들도 고루 분포한다고 하였다.

반응온도 1,000°C와 1,050°C에서의 단면구조는 코팅층과 상호화산층으로 이루어진 전형적인 외향성화산코팅의 구조를 갖고, 950°C에서는 외향성화산코팅과 내향성화산코팅의 중간적인 양상을 보이고 있다.

총상의 석출물은 반응온도 950°C 이상부터 나타나기 시작하여 온도가 증가함에 따라 석출물이 조대해지는 것을 관찰할 수 있다. 원형의 석출물은 반응온도 950°C에서 코팅층 중간에 나타나고 있으며, 온도가 증가함에 따라 감소하고 있다. Fig. 6에 나타낸 EDS 분석 결과로부터 이러한 총상 및 원형의 석출물을 모재에 존재하는 Cr과 Mo가 풍부한 상임을 확인할 수 있었다.

EDS 분석결과와 여러 연구자들^{10)~12)}의 결과를 종합해 볼 때, 이 석출물들은 탄화물(Cr, Mo, C과 TiC)과 σ 상($(Cr, Mo)_x(Ni)_y$)의 혼합조직으로 생각되며, 모재의 조성이 $NiAl$ 로 변화함에 따라 합금원소의 고용도가 낮아져서 석출하는 상이므로 원래의 모재표면을 구분할 수 있게 한다. 따라서, 반응온도 950°C에서 이러한 석출물들이 코팅층 중간에서 내부까지 전반적으로 분포하는 것으로부터, 이 코팅층은 Al의 내향성화산과 Ni의 외향성화산이 같은 정도로 일어나서 형성된 혼합조직인 것으로 생각할 수 있다.

이상의 결과로부터, $AlCl_3$ 의 가열온도 125°C에서 나타나는 코팅층의 주요 상은 반응온도 850°C와 900°C의 경우, Al의 내향성화산에 의한 Ni_2Al_3 이며, 반응온도 1,000°C와 1,050°C의 경우는 Ni의 외향성화산에 의한 Ni-rich $NiAl$ 이다. 그러나 950°C 부근에서는 Al의 내향성화산과 Ni의 외향성화산이 공존하여 Al-rich $NiAl$ 이 형성되었다고 판단된다.

일정한 반응온도에서 Al의 공급이 팩 분말의 Al활동도에 의해서 결정되는 팩세멘테이션 공정과는 달리, 화학증착법에서는 $AlCl_3$ 의 가열온도를 변화시킴으로써 Al의 공급량을 조절할 수가 있다. 따라서, 본 연구

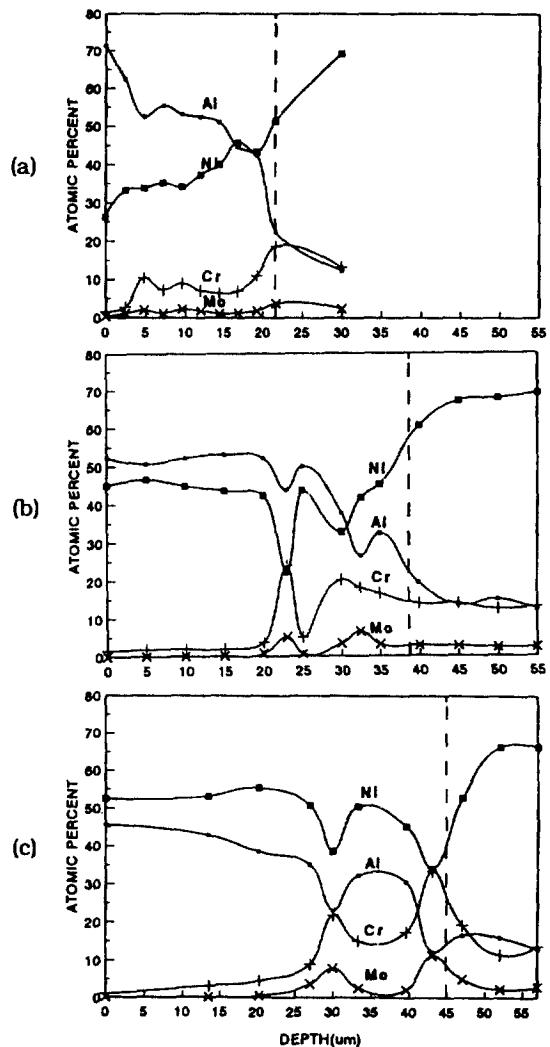


Fig. 6 Concentration profiles in specimens coated at different reaction temperatures : $AlCl_3$ heating temperature 125°C.

(a) reaction temperature 850°C

(b) reaction temperature 950°C

(c) reaction temperature 1,050°C

에서 $AlCl_3$ 가열온도를 125°C로 하였을 때, 기상에서의 Al의 공급량이, 팩세멘테이션 공정에서 순수 Al을 팩 분말로 사용한 경우보다는 적고, Ni_2Al_3 를 팩 분말로 사용한 경우보다는 많기 때문에 반응온도의 조절만으로 코팅층의 상을 변화시킬 수 있었던 것으로 판단된다.

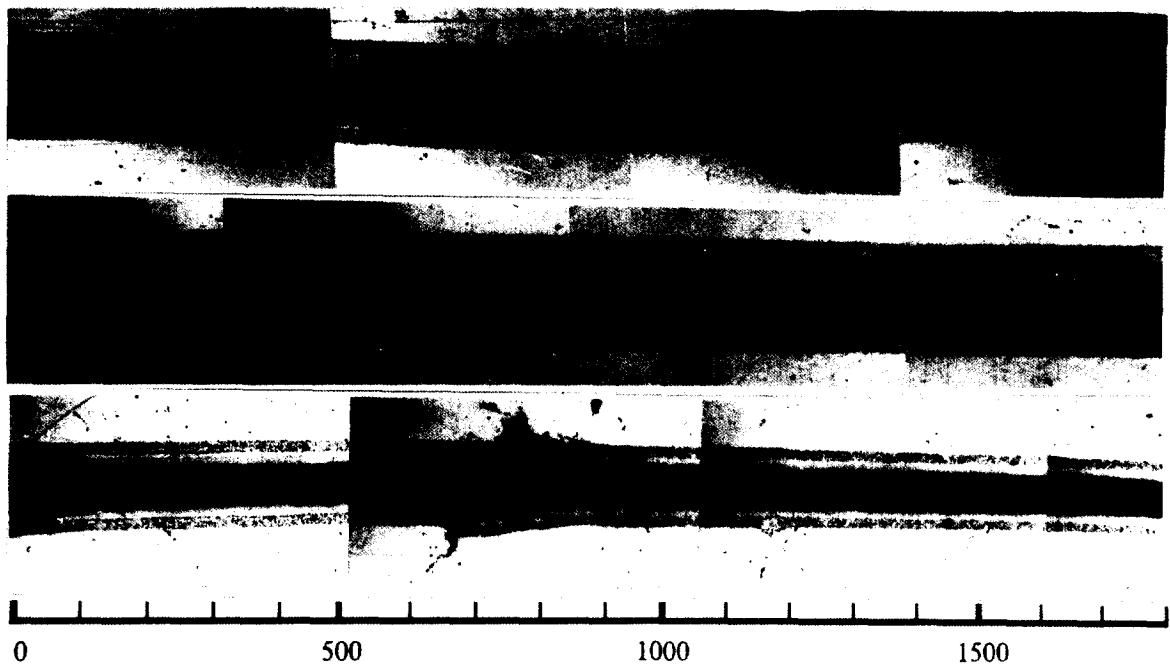


Photo. 3 Variation in coating thickness of aluminide coatings formed by CVD and Pack Cementation at reaction temperature 1,050°C.

- (a) Pack Cementation (gap distance : 100 μm)
- (b) CVD (gap distance : 100 μm)
- (c) CVD (gap distance : 50 μm)

3. 3. 균일증착성

화학증착법은 모재가 팩 분말과 접촉하지 않으므로 복잡한 내부구조를 갖는 재료에 균일한 두께의 코팅층을 형성할 수 있는 것으로 보고되고 있다. 따라서 미세한 틈에 코팅층을 형성시켜 그 양상을 팩세멘테이션 공정과 비교하여 보았다.

100, 50 μm 의 틈에 외향성화산코팅을 팩세멘테이션 공정과 화학증착법으로 실시한 후 그 단면형상을 Photo. 3에 비교하여 나타내었다. 팩세멘테이션 공정의 경우(a), 100 μm 틈에서 면으로부터 약 900 μm 까지 균일하게 코팅층이 형성되었으며, 그후 점점 감소하여 1,600 μm 정도에서부터 코팅층이 형성되지 않았다. 화학증착법은 100 μm 틈의 경우(b), 틈입구로부터 틈중앙까지 균일하게 코팅층이 형성되었으며, 50 μm 틈의 경우(c)도 중앙까지 코팅이 형성되었으나, 코팅두께가 1/3로 감소하였다. 따라서, 외향성화산코팅의 경우에는 화학증착법이 팩세멘테이션 공정보다 균일증착성

이 월등히 우수함을 알 수 있으며, 코팅에 소요되는 반응기체가 틈내부까지 충분히 전달된다고 사료된다. 이는 외향성화산코팅의 경우 3. 1. 2절에서와 같이 반응속도가 고체화산에 의해 지배되어 반응기체의 양은 큰 영향을 미치지 못한다는 것과 밀접한 관계가 있다.

사진에는 나타나 있지 않으나, 내향성화산코팅의 경우도 화학증착법이 팩세멘테이션 공정보다 균일증착성이 더 우수하였다. 그러나, 화학증착법에 의하여 100 μm 틈에 형성된 코팅의 경우에도 깊이 약 600 μm 정도까지만 코팅층이 형성되었으므로 틈내부에 균일하게 코팅층이 형성된다고 볼 수는 없다. 이와 같이 내향성화산코팅의 경우 외향성화산코팅에 비해 균일증착성이 떨어지는 이유는 틈내부표면에서 코팅층이 형성됨에 따라 주요 반응기체인 AlCl₃이 소모되어 평형분압의 감소를 가져오기 때문인 것으로 사료된다. 즉 3. 1. 2절에서 고찰한 바와 같이 내향성화산코팅에서는 코팅층의 형성이 AlCl₃의 평형분압 변화에 민감

하게 반응한다는 것으로 설명할 수 있다.

4. 결 론

화학증착법에 의한 알루미나이드 코팅층의 형성시, 대표적인 공정변수인 반응온도와 AlCl_3 의 공급량을 변화시켜 Ni계 초내열합금인 IN713C에 알루미나이드 코팅층을 형성하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1) 반응온도 850°C 의 경우, AlCl_3 의 가열온도가 증가함에 따라 코팅두께 및 표면에서의 Al 농도가 증가하여 가열온도 125°C 에서 Ni_2Al_3 가 형성되었다. AlCl_3 가열온도 90°C 및 107.5°C 에서 Ni_2Al_3 층이 형성되지 않은 것은 기체반응종들의 양이 부족한데 기인하는 것으로 사료된다.

2) 반응온도 $1,050^{\circ}\text{C}$ 의 경우, AlCl_3 가열온도의 변화는 코팅층에 형성된 상에 영향을 주지 못하였으며 이는 반응이 기체종들의 양보다는 고체확산에 의해 지배되기 때문인 것으로 사료된다.

3) AlCl_3 가열온도 125°C 일 때, 반응온도가 증가함에 따라 코팅층은 Ni_2Al_3 상에서 Al-rich NiAl , Ni-rich NiAl 상으로 변화하였다. 따라서 AlCl_3 가열온도 125°C 에서는 반응온도의 변화만으로 코팅층의 조직을 제어할 수 있었다.

4) 외향성확산코팅 및 내향성확산코팅 모두 화학증착법이 팩세멘테이션 공정보다 균일증착성이 더 우수하였으며, 외향성확산코팅이 내향성확산코팅보다 더욱 효과적이었다.

참 고 문 헌

1. C. T Sims, N. S. Stoloff, and W. C. Hagel : *Superalloys II*, John Wiley and Sons Pub., New York, 1987, pp 4~57.
2. P. C. Patnaik : *Materials & Manufacturing Processes*, 1989, Vol. 4 No. 1, pp 133~152.
3. R. Sivarkumar and B. L. Mordike : *Surface & Coating Technology*, 1989, Vol. 37, pp 139~160.
4. W. P. Sun, H. J. Lin, and M. H. Hon : *Thin Solid Films*, 1987, Vol. 146, No. 55, pp 55~64.
5. J. E. Restall and M. I. Wood : *Materials Science and Technology*, 1986, Vol. 2, p 225.
6. G. Eriksson : *Chemica Scripta*, 1975, Vol. 8 No. 3 pp 100~103.
7. I. Barrin : *Thermochemical Data of Pure Substance*, VCH, New York, 1989
8. S. R. Levine and R. M. Caves : *J. Electrochem. Soc.*, 1974, Vol. 121 No. 8, pp 1051~1064.
9. G. W. Goward and D. H. Boone : *Oxidation of Metals*, 1971, Vol. 3 No. 5, p 475~495.
10. G. G. Slattery : *Met. Tech.*, 1983, Vol. 10, pp 41~51.
11. T. K. Redden : *Trans. TMS-AIME*, 1968, Vol. 242, pp 1695~1702.
12. J. Marglit, G. Kimmel, and S. Niedzwiedz : *J. Inst. Metals*, 1970, Vol. 98, pp 126~127.